

略語（本号で使った主な略語）

AFM	Atomic Force Microscope	原子間力顕微鏡
API	Application Interface	
CAD	Computer Aided Design	コンピュータ支援設計
C-AFM	Conductive Atomic Force Microscopy	電流検出型原子間力顕微鏡
CAM	Computer Aided Manufacturing	コンピュータ支援製造
DCB	Direct Copper Bonding	
EBSD	Electron Backscatter Diffraction	後方散乱電子回折
EDX	Energy Dispersive X-ray Spectrometry	エネルギー分散 X 線分光法
ELCB	Earth Leakage Circuit Breaker	漏電遮断器
EMC	Electromagnetic Compatibility	電磁両立性
EMI	Electromagnetic Interface	電磁妨害
EMS	Electromagnetic Susceptibility	電磁妨害感受性
EPMA	Electron Probe Microanalyzer	電子線マイクロアナライザ
ESCA	Electron Spectroscopy for Chemical Analysis	X 線光電子分光装置
FIB	Focused Ion Beam	集束イオンビーム
FMEA	Failure Mode and Effect Analysis	故障モードおよび影響解析
FMEDA	Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis	安全側故障を考慮した故障率解析
FSM	Functional Safety Management	機能安全管理
FWD	Free Wheeling Diode	
HAZOP	Hazard and Operability Study	
HMI	Human Machine Interface	
HVOF 溶射	High Velocity Oxy-Fuel Thermal Spray	高速フレイム溶射
ICP	Inductively Coupled Plasma	誘導結合プラズマ
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor	絶縁ゲートバイポーラトランジスタ
IPM	Intelligent Power Module	
MCCB	Molded Case Circuit Breaker	配線用遮断器
REACH 規則	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals	化学物質の登録, 評価, 認可及び制限に関する EU (欧州連合) の規則
RFID	Radio Frequency Identification System	
RoHS 指令	Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment	電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限についての EU (欧州連合) の指令
RTOS	Real Time OS	
SIMS	Secondary Ion Mass Spectrometry	二次イオン質量分析法
SPM	Scanning Probe Microscope	走査型プローブ顕微鏡
TEM	Transmission Electron Microscope	透過型電子顕微鏡
UML	Unified Modeling Language	統一モデリング言語
UPS	Uninterruptible Power Supply	無停電電源装置
XAFS	X-ray absorption fine structure	X 線吸収微細構造
XPS	X-ray Photoelectron Spectroscopy	X 線光電子分光装置
XRD	X-ray diffraction	X 線回折
XRF	X-ray Fluorescence Analysis	蛍光 X 線分析



*本誌に記載されている会社名および製品名は、それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。